

З 843.324.406  
УДК 621.382

арсенід галію, матеріал p/n,  
характеристика матеріала  
облучення швидкими електронами.

**В.А. Завадський**, канд. техн. наук., доц.  
(Одеська морська академія)

**В.В. Зубарев**, канд. техн. наук., старш. наук. співроб.  
(Міністерство політики України)

**С.В. Ленков**, д-р техн. наук, проф.  
(Державна комісія з питань ППК України)

**Г.Т. Тарішавілі**, нач. від.  
(ОАО "Укртелеком")

## ВПЛИВ ОПРОМІНЕННЯ ШВИДКИМИ ЕЛЕКТРОНАМИ НА ВЛАСТИВОСТІ АРСЕНІДУ ГАЛІЮ

*Наведено результати експериментальних досліджень характеру впливу опромінення швидкими електронами на основні характеристики арсеніду галію – одного з перспективних матеріалів для бортової електроніки.*

**Вступ.** Електронна авіакосмічна апаратура, насамперед це стосується систем наведення і супроводу цілей, широко використовує оптичні вікна на основі арсеніду галію. Їхнє основне призначення – фільтрація сигналів у ближній інфрачервоній області спектра, що відповідає довжині хвилі 10,6 мкм. Піддаючись опроміненню високоенергетичними частинками і коливанням температури, під час експлуатації вони можуть змінювати свої параметри. Тому дослідження характеру впливу опромінення швидкими електронами на основні характеристики арсеніду галію являють собою не тільки науковий, але і значний практичний інтерес.

Опроміненню дозами електронів  $1 \cdot 10^{15}$ ,  $1 \cdot 10^{16}$ ,  $5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$  були піддані підкладки арсеніду галію, леговані телуром, з концентрацією  $(2-4) \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ , нелеговані епітаксійні шари з концентрацією залишкових домішок  $(5-6) \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ ,  $(1,2-1,8) \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ ,  $(7-8) \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ , а також епітаксійні шари, леговані цинком до концентрації  $(1,3-1,6) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ .

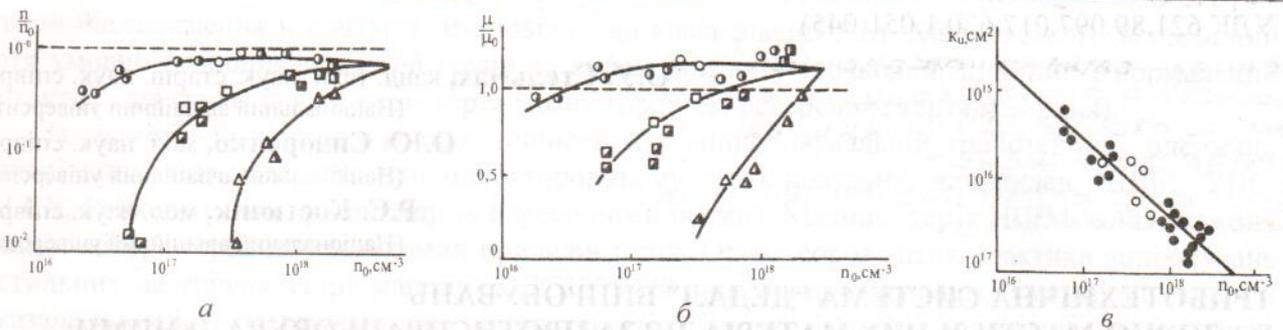
**Результати опромінення.** Мала доза опромінення збільшує питомий опір матеріалу на 6%, концентрація носіїв заряду зменшується на 20%, а їхня рухливість зростає на 15%. Це може бути пов'язано з упорядкуванням структури арсеніду галію при малій дозі опромінення. Радіаційні дефекти в цих умовах ще не виникають.

Збільшення дози опромінення різко збільшує питомий опір матеріалу, зменшує концентрацію носіїв заряду і їхню рухливість. Це свідчить про внесення радіаційних дефектів, що компенсують вихідний матеріал, за рахунок утворення комплексів з домішками і власними атомами. Зі збільшенням концентрації домішок у шарах зменшується ступінь зміни їх електрофізичних параметрів при даній дозі опромінення. І навпаки, найбільше "чисті" зразки ( $5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ ) компенсуються вже при невеликих дозах опромінення. Істотної відмінності в поведженні об'ємних зразків і епітаксійних шарів арсеніду галію не спостерігалось. Також не було відзначено і впливу типу домішки на процеси виникнення радіаційних дефектів. При дозах  $10^{16}$  і  $5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-2}$  епітаксійні шари арсеніду галію настільки сильно компенсувалися радіаційними дефектами, що ставали напівізольюючими та у них було утруднено визначення електрофізичних параметрів.

На графіках залежності відносної зміни концентрації і дози опромінення електронами можна виділити три ділянки (див. рисунок, а, б).

На першій ділянці (псевдогоризонтальна пряма) спостерігається поліпшення електрофізичних параметрів арсеніду галію – зростає рухливість і трохи зменшується концентрація носіїв заряду. На цій ділянці зміни рухливості і концентрації носіїв заряду слабо залежать від їхньої початкової концентрації.

На другій ділянці (вигин ліній) відбувається деяка залежність властивостей від початкової концентрації носіїв заряду: знижується рухливість і концентрація носіїв заряду.



Залежність відносних змін концентрації (а), рухливості (б) і швидкості виведення (в) носіїв заряду в арсеніді галію від початкової концентрації носіїв заряду при опроміненні електронами:

□, ○, △ – підкладки; ● – епітаксійні шари; ○, □, △ – нелеговані епітаксійні шари; □, △ – епітаксійні шари, що леговані цинком

На третій ділянці спостерігається різке погіршення властивостей арсеніду галію. Матеріал компенсується внесеними радіаційними дефектами і поступово стає напівізолюючим.

Отже, появу першої ділянки можна пояснити впорядкуванням структури напівпровідника, що повинно призвести до збільшення рухливості і зменшення концентрації носіїв заряду.

Порогом погіршення електрофізичних властивостей епітаксійних шарів арсеніду галію при опроміненні електронами може служити умова [1]:

$$n_0 \geq (30-40)\Phi_e,$$

де  $n_0$  – концентрація носіїв заряду до опромінення;  $\Phi_e$  – потік опромінення електронами.

Оцінимо темп компенсації носіїв заряду радіаційними дефектами. Вважаємо, що процес виведення носіїв заряду відбувається за експонентним законом:

$$n = n_0 \exp(-K_n \Phi_e),$$

де  $n$  – концентрація носіїв заряду в зразку після опромінення;  $K_n$  – коефіцієнт, що характеризує швидкість виведення носіїв заряду.

Серед фахівців існує думка, що при малих рівнях легування і малих потоках радіації швидкість виведення носіїв заряду для арсеніду галію постійна і не залежить від концентрації й природи домішки [2]. У нашому випадку при концентрації від  $5 \cdot 10^{16}$  до  $1,5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$  коефіцієнт  $K_n$  залежить від початкової концентрації носіїв заряду (див. рисунок, в).

У логарифмічних координатах ця залежність виявилася практично лінійною. Причому швидкість виведення носіїв заряду як в об'ємному матеріалі, так і в епітаксійних шарах була однаковою. Подібний результат залежності швидкості виведення носіїв заряду від їхньої початкової концентрації спостерігався авторами і раніше [1] під час опромінення електронами епітаксійних шарів кремнію.

**Висновок.** У результаті впливу електронів із дозою опромінення  $(1 \div 50) \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$  електрофізичні властивості арсеніду галію поліпшуються до порога дози опромінення. Зміна електрофізичних параметрів не залежить від типу легуючої домішки й обсягу матеріалу (підкладки чи епітаксійні шари). Швидкість виведення носіїв заряду лінійно залежить від їхньої початкової концентрації в епітаксійних шарах. Стійкість епітаксійних шарів арсеніду галію залежить від концентрації домішки і тим більше, чим сильніше вони леговані.

### Список літератури

1. Зубарев В.В., Мокрицький В.А., Салімов Р.М., Савельєв А.В. Радіаційна модифікація параметрів та вивчення стійкості напівпровідникових виробів електронної техніки для космічної апаратури // Нац. акад. оборони України: Тр. акад. – К., 2002. – №39. – С. 293–294.
2. Уваров Е.Ф. Электрофизические свойства полупроводниковых соединений АЗВ5, облученных быстрыми электронами и нейтронами // Обзоры по электронной технике. Сер. Материалы. – 1979. – С. 68.

Стаття надійшла до редакції 02.12.02.